

## Descrição

O Sistema STAUFF de monitoramento de partículas laser LPM é um monitor de partículas em linha de 4 canais à base de laser projetado para o monitoramento contínuo da contaminação por partículas. O LPM fornece informações cumulativas sobre concentrações de partículas nos tamanhos de  $>4 \mu\text{m(c)}$ ,  $>6 \mu\text{m(c)}$  e  $>14 \mu\text{m(c)}$  aplicáveis aos requisitos ISO 4406, ISO 11943 E ISO 11171 para contadores de partículas ópticos. Um canal  $> 21 \mu\text{m(c)}$  fornece informações sobre concentrações de partículas de tamanho maior.

A atenção dos operadores é alertada sobre os níveis de concentração de partículas no fluido de sua máquina através das indicações dadas pelo LPM. O nível de

contaminação será mostrado no display ou será enviado até um PC através da porta serial RS-232. A porta serial ModBus permite enviar os dados até uma rede de computadores ou até um display externo. A configuração do transdutor de partículas LPT se faz através da porta IR num Palm ou computador de bolso. O sistema do LPM consiste num transdutor de partículas a laser (LPT) e num módulo interface a laser - LIM (veja o diagrama de operação).



## Diagrama de operação

